

共用施設ネットワーク

Network of Open Research Facilities in TIA-nano

概要 Outline TIA-nanoの中核4機関である産総研、NIMS、筑波大学、KEKでは、ナノテクノロジー研究を支える数々の最先端施設、装置を共用施設として公開しています。

A portion of leading-edge facilities and equipment for materials synthesis, microfabrication, prototype device fabrication, physical property measurement and nanoscale measurement/analysis in four core institutes of TIA-nano (AIST, NIMS, University of Tsukuba and KEK) are open to the public as open research facilities.

つくばの共用施設ネットワーク



直径15km圏内に400台弱の共用装置 (4機関、12の共用施設)

There are near 400 apparatuses (12 facilities of 4 institutions) in Tsukuba within 15 km diameter

装置紹介

成膜装置 Deposition system (examples)



原子層堆積装置
Atomic Layer
Deposition System



スパッタリング装置
Sputtering Deposition
System



プラズマCVD装置
Plasma-Enhanced Chemical
Vapor Deposition System

微細加工装置 Microfabrication System (examples)



マスクレス露光装置
Maskless Processing
Apparatus



微細組織三次元
マルチスケール解析装置
Versatile triple-beam
scanning electron microscope



FIB-SEM

計測・観測装置 Measurement apparatus (examples)



ヘリウムイオン顕微鏡
Helium Ion Microscope



陽電子欠陥評価装置
Positron Probe Microanalyzer



1MVタンデロン実験室
1.0 MV TANDETRON



レーザー加熱超高压X線複合実験
ステーション
X-Ray Diffraction and Mössbauer
Spectroscopy Experiments at High
Pressure



六軸X線回折計用実験
ステーション
X-ray Scattering
Experiments for Material
Structural Science